

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第6部門第1区分  
【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公表番号】特表2004-521329(P2004-521329A)  
【公表日】平成16年7月15日(2004.7.15)  
【年通号数】公開・登録公報2004-027  
【出願番号】特願2002-554887(P2002-554887)  
【国際特許分類第7版】

G 0 1 J 1/02

【F I】

G 0 1 J 1/02 C

【手続補正書】

【提出日】平成16年12月16日(2004.12.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

赤外線検出器を收容する空洞と、赤外線放射を前記検出器に向けて透過する窓領域とを有するパッケージカバーであって、前記空洞内の前記窓領域の内面が、前記窓領域を透過する赤外線放射に対する反射防止要素を形成するように形作られ間隔を空けて配置された柱のフィールドを有するパッケージカバー。

【請求項2】

入射赤外線放射に応答して電気信号を生成するピクセルのアレイと、  
前記アレイを保持する基板と、  
前記放射を前記アレイに向けて透過するために、空洞内に窓を有するパッケージカバーと、  
前記赤外線放射の反射を減少させるために、前記窓内に間隔を空けて配置された柱のフィールドとを含む赤外線検出器。

【請求項3】

赤外線放射を透過することができる材料のウェーハで赤外線光学要素を製造する方法であって、  
柱のフィールドの断面を画定するパターンで前記ウェーハの表面をマスクするステップと、  
前記柱のフィールドを所望の深さに形成するように、前記ウェーハ表面をエッチングするステップと、  
前記ウェーハの表面に空洞を画定する形で前記柱のフィールドをマスクするステップと、  
前記ウェーハに空洞を形成するように、前記柱のフィールドを含んだ前記ウェーハ表面をエッチングするステップとを列挙された順番で含む方法。

【請求項4】

赤外線光学装置を製造する方法であって、  
赤外線放射を透過することができる材料のウェーハの表面を、柱のフィールドを画定するパターンでマスクするステップと、  
前記柱のフィールドを所望の高さに形成するように、前記ウェーハ表面をエッチングするステップと、

前記ウェーハの他の表面に反射防止要素を付けるステップと、  
ポロメータのアレイを含む基板に前記ウェーハを封着するステップとを含む方法。